# ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ ДИСЛОКАЦИЙ В НАНОМАТЕРИАЛАХ

### Малашенко В. В., Малашенко Т. И.

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, Донецк, Украина,

malashenko@kinetic.ac.donetsk.ua

Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина

Свободные поверхности кристалла, а также границы раздела в поликристаллах способны оказывать существенное, а иногда и определяющее влияние на различные свойства кристаллов, в том числе механические, и в частности, на динамическое скольжение дислокаций [1]. Особенно возрастает роль поверхности и межзеренных границ в наноматериалах, исследование которых является одним из наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений современной физики [2, 3].

При движении дислокаций в приповерхностных слоях кристалла возрастает роль так называемых сил изображения, действующих на дислокацию со стороны свободной поверхности или межкристаллитной границы. В большинстве работ по исследованию влияния сил изображения на поведение дислокаций, выполненных в последние годы, методами компьютерного моделирования решалась задача о выходе дислокации на поверхность либо анализировался процесс роста кристалла [4].

Поверхность, являясь структурным дефектом, может и сама содержать различные дефекты, например, точечные, и влиять не только на движение дислокаций, но и на их взаимодействие с точечными дефектами, содержащимися как на поверхности, так и в объеме кристалла. Однако влияние сил изображения на динамическое торможение дислокации точечными дефектами ранее не изучалось.

Пусть бесконечная краевая дислокация движется под действием постоянного внешнего напряжения  $\sigma_0$  в положительном направлении оси ОХ с постоянной скоростью  $\nu$  параллельно поверхности кристалла, совпадающей с плоскостью XOZ. Линия дислокации параллельна оси ОZ, а ее вектор Бюргерса параллелен оси ОХ. Точкам кристалла отвечают значения  $y \leq 0$ . Плоскость скольжения дислокации совпадает с плоскостью y = -L, а положение дислокации определяется функцией

$$X(y = -L, z, t) = vt + w(y = -L, z, t)$$
. (1)

Здесь функция w(y=-L,z,t) является случайной величиной, описывающей колебания элементов краевой дислокации в плоскости скольжения относительно невозмущенной дислокационной линии.

Уравнение движения дислокации имеет следующий вид

$$m\left\{\frac{\partial X^{2}}{\partial t^{2}}-c^{2}\frac{\partial^{2} X}{\partial z^{2}}\right\}=b\left[\sigma_{0}+\sigma_{xy}^{i}(vt+w;z)+\sigma_{xy}^{s}(vt+w;z)\right]-B\frac{\partial X}{\partial t}.$$
 (2)

Здесь  $\sigma_{xy}^{S}$  – компонента тензора напряжений, создаваемых поверхностными точечными дефектами на линии дислокации,  $\sigma_{xy}^{i}$  – силы изображения, действующие на дислокацию благодаря наличию свободной поверхности.

Силу динамического торможения дислокации поверхностными точечными дефектами вычислим во втором порядке теории возмущений

$$F_{S} = \frac{n_{s}b^{2}}{4\pi m} \int dq_{x}dq_{z} |q_{x}| \cdot |\sigma_{xy}(q_{x}, q_{z}, y)|^{2} \delta(q_{x}^{2}v^{2} - \omega^{2}(q_{z})).$$
 (3)

Здесь  $n_s$  — поверхностная концентрация точечных дефектов,  $\delta(q_x^2 v^2 - \omega^2(q_z))$  — это  $\delta$ -функция Дирака,  $\omega(q_z)$  — спектр дислокационных колебаний, который имеет вид

$$\omega^2 = c^2 q_z^2 + \Delta_S^2; \qquad \Delta_S = \frac{b}{L} \sqrt{\frac{D}{2m}} \approx \frac{c}{L}$$
 (4)

Выполним численные оценки. Возьмем типичные значения  $c=3\cdot 10^3$  м/с ,  $b=3\cdot 10^{-10}$  м . Тогда для  $L\approx 10b$  получим  $\Delta_S\approx 10^{12}\,{\rm c}^{-1}$  , для  $L\approx 100b$  оценки дают  $\Delta_S\approx 10^{11}\,{\rm c}^{-1}$ . Выполняя интегрирование, получим выражение для силы торможения дислокации поверхностными дефектами

$$F_{S} = \frac{n_{s}b^{2}\mu^{2}\varepsilon^{2}R^{6}}{mc} \left(\frac{\Delta_{S}^{9}L^{3}}{v^{11}}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{2L\Delta_{S}}{v}\right)$$
 (5)

Значение предэкспоненциального множителя не превышает силу электронного торможения, т.е. само по себе весьма мало, а экспонента делает эту величину пренебрежимо малой. Следовательно, можно говорить о блокировке механизма торможения дислокации, связанного с возбуждением дислокационных колебаний поверхностными примесями. Таким образом, свободная поверхность не создает силу, действующую на дислокацию в плоскости скольжения, но она препятствует возникновению дислокационных колебаний в этой плоскости.

Рассмотрим теперь случай, когда краевая дислокация движется параллельно поверхности кристалла, содержащего точечные дефекты, случайным образом распределенные в его объеме.

Динамическое взаимодействие распределенных в объеме кристалла дефектов с дислокацией в зависимости от скорости дислокационного скольжения может иметь как коллективный характер, так и характер независимых столкновений [5–9]. Точечные дефекты тоже оказывают влияние на дислокационный спектр: они создают щель в области коллективного взаимодействия с дислокацией, то есть в области, где дислокация за время взаимодействия с дефектом успевает "почувствовать" влияние многих других дефектов. Эта щель, согласно [9], описывается выражением

$$\Delta_d = \frac{c}{b} \left( n_{0V} \varepsilon^2 \right)^{1/3} = \frac{c}{l} ; \qquad b \left( n_{0V} \varepsilon^2 \right)^{-1/3} = l \approx l_d$$
 (6)

Здесь  $n_0$  – безразмерная концентрация точечных дефектов,  $n_0 = nR^3$ ,

 $l_d$  — среднее расстояние между дефектами в кристалле. В области независимых столкновений щель в спектре дислокационных колебаний не возникает.

Таким образом, вид колебательного спектра определяется конкуренцией взаимодействия дислокации с поверхностью и с точечными дефектами. В зависимости от их соотношения сила динамического торможения дислокации точечными дефектами может характеризоваться различной зависимостью от параметров задачи (концентрации точечных дефектов, удаленности дислокации от свободной поверхности, упругих модулей кристалла и так далее). Указанные выше взаимодействия дают аддитивный вклад в формирование спектральной щели

$$\Delta^2 = \Delta_S^2 + \Delta_d^2 \tag{7}$$

В этом случае главный вклад в формирование щели вносят силы изображения. Граница этой области определяется неравенствами

$$(bc/v) \gg L$$
;  $l \gg L$ . (8)

Поскольку влияние поверхности является доминирующим в данной области, сила торможения зависит от расстояния до этой поверхности

$$F_d = \mu b n_{0V} \varepsilon^2 \frac{v}{c} \left(\frac{L}{b}\right)^2 \tag{9}$$

Чтобы оценить степень влияния поверхности на движение дислокаций, возьмем отношение сил торможения  $F_{d2}$  в приповерхностном слое, где влияние поверхности доминирует, и  $F_{d1}$  в слое, где оно не существенно

$$\frac{F_{d2}}{F_{d1}} = \left(\frac{L}{l}\right)^2 \tag{10}$$

Выполним численные оценки. Для значений  $n_{0V}\approx 10^{-4}$ ,  $\epsilon\approx 10^{-1}$ ,  $L\approx 10b$  получим  $(F_{d2}/F_{d1})\approx 10^{-2}$ , то есть наличие поверхности приводит к уменьшению силы торможения на два порядка. Таким образом, наличие поверхности значительно снижает влияние точечных дефектов на скольжение дислокаций в приповерхностной области.

Оценим толщину приповерхностного слоя, в пределах которого поверхность оказывает существенное влияние на динамическое взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Для типичных значений  $c=3\cdot 10^3 \,\mathrm{m/c}$ ,  $b=3\cdot 10^{-10} \,\mathrm{m}$ ,  $n_{0V}\approx 10^{-2}\div 10^{-6}$ ,  $v\approx 10^{-2}\div 10^{-1}c$  получим, что толщина оцениваемого слоя может составлять от нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров.

Таким образом, можно сделать вывод, что силы изображения полностью блокируют влияние поверхностных точечных дефектов и значительно снижают влияние объемно распределенных точечных дефектов на динамическое скольжение дислокаций в наноматериалах, т.е. облегчают пластическое деформирование мягких металлов, имеющих нанометровые размеры и содержащих примеси высокой концентрации.

#### Список литературы

- 1. Kodambaka S., S. V. Khare, W. Swich, K. Ohmori, I. Petrov, J. E. Greene. // Nature. 2004. Vol. 429. P. 49–52.
- 2. Головин Ю. И. // ФТТ. 2008. Т. 50, № 12. С. 2113–2142.
- 3. Малыгин Г. А. // ФТТ. -2007. Т. 49, № 6. С. 961- 982.
- 4. Liu X. H., F. M. Ross, K. W. Schwarz. // Phys. Rev. Lett. − 2000. − Vol. 85, № 19. − P. 4088–4091.
- 5. Малашенко В. В. // Кристаллография. 2009. Т. 54, № 2. С. 312–315.
- 6. Малашенко В. В. // ФТТ. -2009. Т. 51, № 4. С. 703-705.
- 7. Малашенко В. В. // ЖТФ. 2009. Т. 79, № 4. С. 146–149.
- 8. Malashenko V. V. // Modern Phys. Lett. B. 2009. Vol. 23, № 16. P. 2041–2047.
- 9. Malashenko V. V. // Physica B: Phys. Cond. Mat. 2009. Vol. 404, № 21. P. 3890–3893.

# ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ В КРИСТАЛЛАХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

### Малашенко В.В.

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, Донецк, Украина, malashenko@kinetic.ac.donetsk.ua
Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина

Движение дислокаций и их взаимодействие друг с другом, с другими дефектами, а также с фононами, электронами, магнонами, оказывает огромное влияние на механические свойства реального кристалла [1-3]. Важным и пока что недостаточно изученным аспектом динамики дислокаций является их взаимодействие с точечными дефектами кристаллической решетки (вакансии, примеси, междоузельные атомы), которые